



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月11日

出願番号

Application Number:

特願2001-003330

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2001年 5月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 2320320115

【提出日】 平成13年 1月11日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B09B 3/10

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 三島 基道

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 小川 光康

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 東山 義幸

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 下村 繁彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 松代 忠

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 上野 聖一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

前田 裕巳

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

木村 昌弘

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-248374

【出願日】

平成12年 8月18日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 脱臭装置及びそれを備えた生ごみ処理機

【特許請求の範囲】

【請求項1】 触媒ヒータを内設した金属パイプに、少なくとも1つ以上の孔を設けた金属薄板を複数固定して形成し触媒を担持したフィンを備え、前記対向するフィンは仕切り板で仕切られて少なくとも一条以上の通路を形成し、前記金属パイプとフィンを筒状のケースに収容してなる脱臭装置。

【請求項2】 仕切り板をフィンの一部を切り起こして形成した請求項1記載の脱臭装置。

【請求項3】 金属薄板に複数個の凹凸を形成した請求項1または2記載の脱臭装置。

【請求項4】 金属パイプに円形の金属薄板を複数固定した請求項1乃至3のいずれか1項に記載の脱臭装置。

【請求項5】 フィンの外周に金属の網を巻いた請求項1乃至4のいずれか1項に記載の脱臭装置。

【請求項6】 フィンの外周に巻いた金属の網に触媒を担持した請求項5記載の脱臭装置。

【請求項7】 触媒ヒータに放熱フィンを設けた請求項1乃至6のいずれか1 項に記載の脱臭装置。

【請求項8】 触媒ヒータに設けた放熱フィンに触媒を担持した請求項7記載の脱臭装置。

【請求項9】 フィンの下流側になるに従って触媒ヒータのワット密度を変化させる請求項1乃至8のいずれか1項に記載の脱臭装置。

【請求項10】 触媒ヒータを内設した金属パイプを複数有する請求項1乃至 9のいずれか1項に記載の脱臭装置。

【請求項11】 発熱面積の異なる複数の触媒ヒータを装着した請求項10記載の脱臭装置。

【請求項12】 金属パイプに金属薄板を複数固定して形成したフィンに加え、更にハニカム触媒を固定した請求項1乃至11のいずれか1項に記載の脱臭装

置。

【請求項13】 温度検出部を排ガス通過通路の上流側に設けた請求項1乃至12のいずれか1項に記載の脱臭装置。

【請求項14】 脱臭装置内の異常燃焼を検知し触媒ヒータを停止する請求項 13記載の脱臭装置を備えた生ごみ処理機。

【請求項15】 脱臭装置内の異常燃焼を検知し運転を停止する請求項13または14記載の脱臭装置を備えた生ごみ処理機。

【請求項16】 排気通路に触媒を担持した請求項1乃至15のいずれか1項 に記載の脱臭装置を備えた生ごみ処理機。

【請求項17】 吸気通路およびまたは排気通路に低温触媒を担持した請求項 1万至15のいずれか1項に記載の脱臭装置を備えた生ごみ処理機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は生ごみ処理機等から発生する臭気成分や油煙などを浄化する脱臭装置およびそれを備えた生ごみ処理機に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、生ごみ処理機では、生ごみを加熱することから発生する臭いや油煙を浄化するために、触媒を用いるものがある。従来の生ごみ処理機の一例を図11、図12に示す。図11において、121は生ごみ処理機本体、122は生ごみを収納する収納部で、ほぼ中央部に回転軸123、生ごみを撹拌する撹拌羽根124を備えている。収納部122の上部に生ごみを加熱する加熱手段125が配してある。加熱手段125は乾燥用ヒータ126及び、乾燥ファン127から構成され、熱風を生ごみに当てて生ごみの表面を加熱する。尚、乾燥ファン127は乾燥モータ128により回転駆動される。収納部122に吸気通路103および排気通路136が形成され、前記両通路間に金属パイプ101に帯状の金属薄板を螺旋状に巻回して形成したフィン102に触媒を担持し、このフィン102を配置して金属パイプ101内に装着した触媒ヒータ108で触媒を加熱して臭気

成分を酸化分解する脱臭装置137が設置されている。(図12参照)収納部122の天面には吸気口133、排気通路136の後方には排気ファン134が設置されている。135は回転軸123を駆動する駆動モータである。

[0003]

上記従来の生ごみ処理機において、生ごみ処理機本体121の運転(生ごみの加熱)と同時に脱臭装置137の触媒ヒータ108により触媒が加熱され、排気ファン134も作動すると、吸気口133から外気が吸引され、収納部122内の臭気を含む空気を脱臭装置137で脱臭し、外部に排気する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら上記従来の構成では、脱臭装置137の浄化能力を高めようとすると、フィン102の巻回数を多くする必要がある。但し、前記のように、フィン102の巻回数を多くすると、排ガスが流れる時の圧力損失が大きくなり、排ガスが流れにくいという問題があった。また、浄化能力を高める手段として他に、フィン102の表面積を大きくする方法がある。金属パイプ101に帯状の金属薄板を螺旋状に巻回して形成する時には、螺旋状のフィン102の内径部、即ち金属パイプ101に接触する部分に襞(図示せず)を作らなければならないが、フィン102の表面積を大きくするために、フィン102の外径を大きくすると前記襞の深さが深くなってしまい製造不能であったり、また、フィン102の外径が大きくなると、螺旋状のフィン102の外周部を均一な円にすることが困難であり、螺旋状のフィン102の螺旋の外径を大きくできないという問題があった。

[0005]

本発明は上記課題を解決するもので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を 担持したフィンの枚数およびフィンの外径を大きくすることで、フィン全体の表 面積が大きくなり、それにより排ガスがフィンと通過時に接触する面積が大きく なることで、浄化能力を高めた脱臭装置を提供することを目的とするものである

[0006]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明は、触媒ヒータを内設した金属パイプに、少なくとも1つ以上の孔を設けた金属薄板を複数固定して形成し触媒を担持したフィンを備え、前記対向するフィンは仕切り板で仕切られて少なくとも一条以上の通路を形成し、前記金属パイプとフィンを筒状のケースに収容してなるもので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィンの枚数およびフィンの外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、それにより排ガスがフィンと通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めるものである。

[0007]

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1記載の発明は、触媒ヒータを内設した金属パイプに、少なくとも1つ以上の孔を設けた金属薄板を複数固定して形成し触媒を担持したフィンを備え、前記対向するフィンは仕切り板で仕切られて少なくとも一条以上の通路を形成し、前記金属パイプとフィンを筒状のケースに収容してなるもので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィンの枚数およびフィンの外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、それにより排ガスがフィンと通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めるものである。

[0008]

本発明の請求項2記載の発明は、上記請求項1記載の発明において、仕切り板をフィンの一部を切り起こして形成したもので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィンの枚数およびフィンの外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、それにより排ガスがフィンと通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めるものである。

[0009]

本発明の請求項3記載の発明は、上記請求項1または2記載の発明において、 金属薄板に複数個の凹凸を形成したもので、浄化能力をより高めた脱臭装置を提 供できる。

[0010]

本発明の請求項4記載の発明は、上記請求項1乃至3のいずれか1項に記載の 発明において、金属パイプに円形の金属薄板を複数固定したもので、脱臭装置の 形成を容易にできる。

[0011]

本発明の請求項5記載の発明は、上記請求項1万至4のいずれか1項に記載の発明において、フィンの外周に金属の網を巻いたもので、フィンの外周に巻く断熱シール材が排ガスの通過径路に飛び出して通路が狭まらない脱臭装置を提供できる。

[0012]

本発明の請求項6記載の発明は、上記請求項5記載の発明において、フィンの 外周に巻いた金属の網に触媒を担持したもので、浄化能力をより高めた脱臭装置 を提供できる。

[0013]

本発明の請求項7記載の発明は、上記請求項1乃至6のいずれか1項に記載の 発明において、触媒ヒータに放熱フィンを設けたもので、触媒ヒータの異常加熱 を防止した脱臭装置を提供できる。

[0014]

本発明の請求項8記載の発明は、上記請求項7記載の発明において、触媒ヒータに設けた放熱フィンに触媒を担持したもので、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0015]

本発明の請求項9記載の発明は、上記請求項1万至8のいずれか1項に記載の 発明において、フィンの下流側になるに従って、触媒ヒータのワット密度を変化 させるもので、フィンの熱分布を一定にすることにより、浄化能力をより高めた 脱臭装置を提供できる。

[0016]

本発明の請求項10記載の発明は、上記請求項1乃至9のいずれか1項に記載の発明において、触媒ヒータを内設した金属パイプを複数有するもので、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0017]

本発明の請求項11記載の発明は、上記請求項10記載の発明において、発熱 面積の異なる複数の触媒ヒータを装着したもので、フィンの熱分布を一定にして 、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0018]

本発明の請求項12記載の発明は、上記請求項1乃至11のいずれか1項に記載の発明において、金属パイプに金属薄板を複数固定して形成したフィンに加え、更にハニカム触媒を固定したもので、小型で浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0019]

本発明の請求項13~15記載の発明は、上記請求項1乃至12のいずれか1項に記載の発明において、温度検出部を排ガス通過通路の上流側に設け脱臭装置内の異常燃焼を検知し、触媒ヒータを停止または運転を停止する生ごみ処理機を提供できる。

[0020]

本発明の請求項16記載の発明は、上記請求項1万至15のいずれか1項に記載の発明において、排気通路に触媒を担持したもので、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0021]

本発明の請求項17記載の発明は、上記請求項1乃至15のいずれか1項に記載の発明において、吸気通路およびまたは排気通路に低温触媒を担持したもので、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0022]

【実施例】

(実施例1)

以下、本発明の第1の実施例について添付図面をもとに説明する。図1、図2において、ケース21内に金属パイプ1に放射状に2個の孔22を設けた円形の金属薄板を固定してフィン2を形成し、フィン2の表面には触媒を担持し、対向するフィン2は放射状の2枚の仕切り板23で仕切られて、図3に示すように2

条の通路を形成したフィンを収納し、金属パイプ1内には触媒ヒータ24を装着してある。フィン2の外周には金属の網25を巻き、更にその外周にはシール用断熱材26を巻いている。27は排ガスの吸気通路であるケース21の入り口パイプ、28は排ガスの排気通路である出口パイプである。金属パイプ1内の入り口パイプ27に近い部分には放熱フィン29を設置していて、前記放熱フィン29には、触媒を担持させている。また、フィン2の外周に金属の網25を巻き、さらに金属の網25に触媒を担持させている。さらに、フィン2の下流側になるに従って触媒ヒータ24のワット密度が小さくなるような構成となっている。

[0023]

上記構成においては、図3のように、フィン2は放射状に2枚の仕切り板23 で仕切られて、排ガスが180°周回して上方へ流れていく、2条の通路を形成 しているので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィン2の枚数 およびフィン2の外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、 それにより排ガスがフィン2と通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化 能力を高めるものである。また、放熱フィン29は触媒ヒータ24の熱を放出し て触媒ヒータ24の異常加熱を防止することができる。また、フィン2の外周に 金属の網25を巻いた構成とすることにより、フィン2の外周に巻く断熱シール 材26がフィン2の径路に飛び出して排ガスの通過通路が狭まらず、また、フィ ン2の外周に巻いた金属の網25や放熱フィン29に触媒を担持することにより 、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。さらに、フィン2の下流側にな るに従って触媒ヒータ24のワット密度が小さくなるような構成となっている、 いわゆる上流側においては、ワット密度が大きくなっていることで、排ガスがフ ィン2を通過する前に主に加熱され、加熱された前記排ガスが前記フィン2を通 過することで、前記フィン2の熱分布の均一化を図り、浄化能力をより高めるこ とができる。

[0024]

(実施例2)

次に、本発明の第2の実施例について図4、図5をもとに説明する。なお、上 記実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。図

4、図5において、ケース21内に金属パイプ1に放射状に複数のフィン2の切り起こし部30を設けた円形の金属薄板を固定してフィン2を形成し、フィン2の表面には触媒を担持したフィン2を収納し、金属パイプ1内には触媒ヒータ24を装着してある。

[0025]

上記構成において、フィン2は放射状に複数のフィン2の切り起こし部30を設け、多条の通路を形成しているので、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィン2の枚数およびフィン2の外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、それにより排ガスがフィン2と通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めるものである。

[0026]

(実施例3)

次に、本発明の第3の実施例について図6、図7をもとに説明する。なお、上記実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。図6、図7において、ケース21(図示せず)内に金属パイプ1に放射状に4個の孔22を設けた円形の金属薄板を複数固定してフィン2を形成し、フィン2の表面には触媒を担持し、対向するフィン2は放射状の4枚の仕切り板23で仕切られて4条の通路を形成したフィン2を収納し、金属パイプ1内には2本の触媒ヒータ24を装着してある。また、触媒ヒータ24に放熱フィン29を設けている。また、それぞれ触媒ヒータ24は、発熱面積の異なる触媒ヒータ24であり、本実施例においては、一方の触媒ヒータ24aは全体が発熱し、他方の触媒ヒータ24bは下方のU字部分のみが発熱する構成を成している。

[0027]

上記構成において、フィン2は放射状の4枚の仕切り板23で仕切られて、排ガスが90°周回して上方へ流れていく、4条の通路を形成しているので、圧力損失を大きくすることなく触媒を担持したフィン2の枚数を多くして表面積を大きくし、また複数の触媒ヒータ8を設置しているのでフィン2の外径を大きくして表面積を更に広げ、排ガスがフィン2と通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めるものである。また、触媒ヒータ24に放熱フィン29を

設けているので、触媒ヒータ24の熱を放出して触媒ヒータ24の異常加熱を防止することができる。また、一方の触媒ヒータ24 a は全体が発熱し、他方の触媒ヒータ24 b は下方のU字部分のみが発熱する構成を成していて、触媒を活性化するまでは全体が発熱する触媒ヒータ24 a を用いて短時間でフィン2を加熱し、触媒を活性化した後には下方のU字部分のみが発熱する触媒ヒータ24 b を用いて、排ガスがフィン2を通過する前に主に加熱され、加熱された前記排ガスが前記フィン2を通過することで、前記フィン2の熱分布の均一化を図り、浄化能力をより高めるものである。

[0028]

(実施例4)

次に、本発明の第4の実施例について図8をもとに説明する。なお、上記実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。図8において、ケース21の排ガスの入り口に近い部分に温度検出部31を設けている。温度検出部31は触媒ヒータ24の温度を検知し、ケース21内で異常燃焼が起きた時、触媒ヒータ24の通電を停止、あるいは、生ごみ処理機本体の通電を停止して触媒ヒータ24の断線や、脱臭装置の損傷を防止することができる。また、32は出口パイプ28に連通した吸引ファンである。排気通路である出口パイプ28内は高温であり、排気通路内に触媒を担持することによって、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。また、入り口パイプ27の外周に加熱ヒータ33を設け、排ガスの吸気通路である入り口パイプ27の外周に加熱ヒータ33を設け、排ガスの吸気通路である入り口パイプ27及びまたは排ガスの排気通路である出口パイプ28内に、フィン2に担持した触媒より低い温度で機能する低温触媒を担持することによって、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0029]

(実施例5)

次に、本発明の第5の実施例について図9をもとに説明する。なお、上記実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。図9において、金属パイプに円形の金属薄板を複数固定して形成したフィン2を備え、更にハニカム触媒34を固定してある。ハニカム触媒34は小型で表面積を大きく

することができ、この構成にすることにより小型で浄化能力をより高めた脱臭装置を提供できる。

[0030]

(実施例6)

次に、本発明の第6の実施例について図10をもとに説明する。なお、上記実施例と同一構成部品については同一符号を付して、その説明を省略する。図10において、第2のフィン35は、円形の金属薄板に複数個の凹凸36を形成し、表面に触媒を担持したもので他の構成は、第3の実施例と同じである。この場合、凹凸により表面積が増え、触媒の担持量を増やすことができるとともに、第2のフィン上を空気が流れる際に乱流が発生するため、空気に含まれる臭気成分がフィン表面に万遍なく接触することになり、浄化能力をより高めた脱臭装置を提供することができる。

[0031]

【発明の効果】

本発明によれば、圧力損失を大きくすることなく、触媒を担持したフィンの枚数およびフィンの外径を大きくすることで、フィン全体の表面積が大きくなり、それにより排ガスがフィンと通過時に接触する面積が大きくなることで、浄化能力を高めた脱臭装置及びそれを備えた生ごみ処理機を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施例の脱臭装置の斜視図

【図2】

同脱臭装置の断面図

【図3】

図1のA-A断面図

【図4】

本発明の第2の実施例の脱臭装置の斜視図

【図5】

同脱臭装置の部分断面図

【図6】

本発明の第3の実施例の脱臭装置の斜視図

【図7】

同フィンの斜視図

【図8】

本発明の第4の実施例の脱臭装置の斜視図

【図9】

本発明の第5の実施例の脱臭装置の斜視図

【図10】

本発明の第6の実施例のフィンの斜視図

【図11】

従来の生ごみ処理機の断面図

【図12】

同脱臭装置の断面図

【符号の説明】

- 1 金属パイプ
- 2 フィン
- 21 ケース
- 22 孔
- 23 仕切り板
- 24 触媒ヒータ
- 35 第2のフィン
- 3 6 凹凸

【書類名】

図面

【図1】

| …- 金属パイプ

2 --- フィン

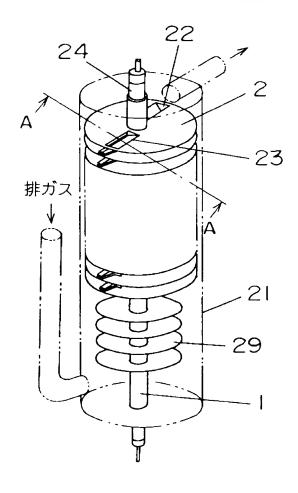
21 ---ケース

22…孔

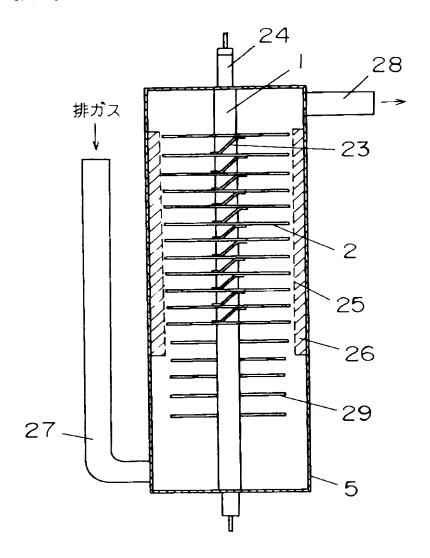
23 … 仕切り板

24 --・触媒ヒータ

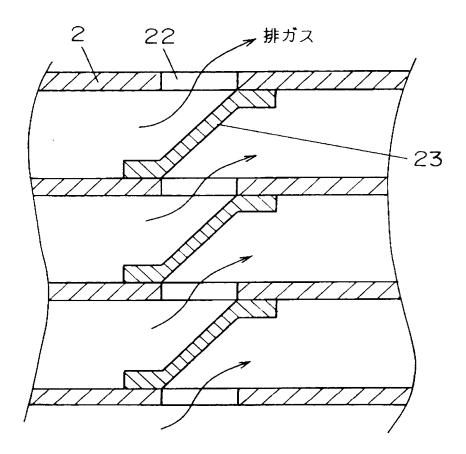
29 --- 放熱フィン



【図2】

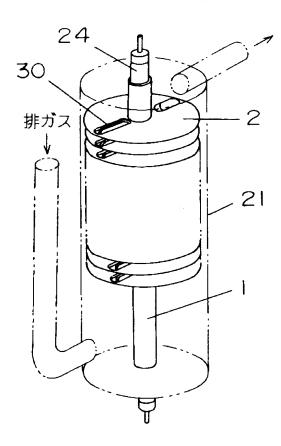


【図3】

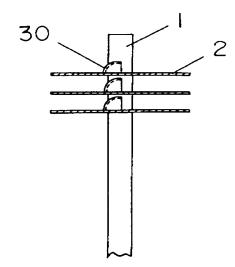


【図4】

30---切り起こし部

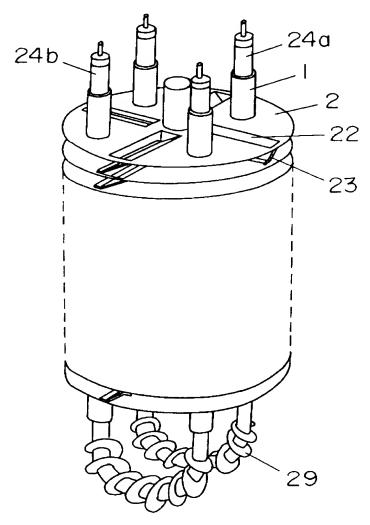


【図5】

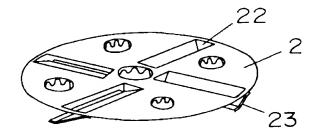


【図6】

29…放熱フィン

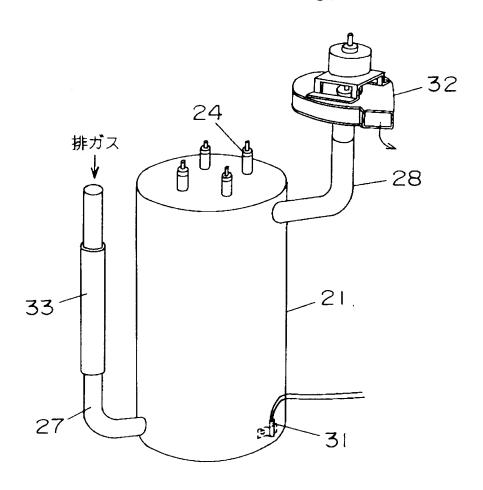


【図7】



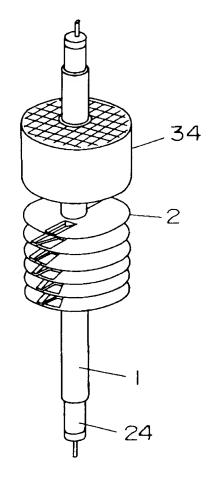
[図8]

31 --- 温度検出部

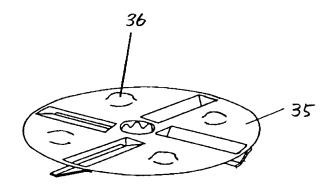


【図9】

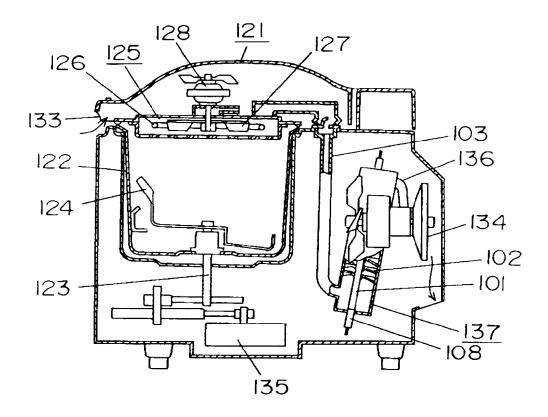
34 ---ハニカム触媒



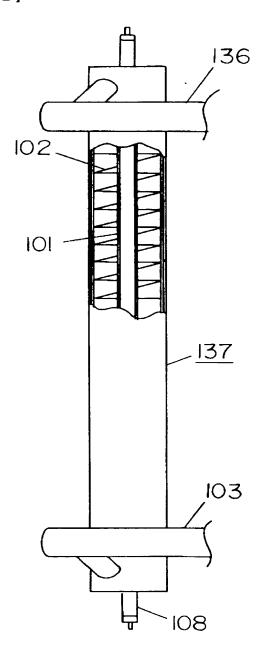
【図10】



【図11】



【図12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧力損失を大きくすることなく、排ガスがフィンと通過時に接触する面積を大きくすることで、浄化能力を高めた脱臭装置を提供する。

【解決手段】 触媒ヒータ24を内設した金属パイプ1に、少なくとも1つ以上の孔22を設けた金属薄板を複数固定して形成し触媒を担持したフィン2を備え、前記対向するフィン2は仕切り板23で仕切られて少なくとも一条以上の通路を形成し、前記金属パイプ1とフィン2を筒状のケース21に収容してなるもので、圧力損失を大きくすることなく、排ガスがフィンと通過時に接触する面積を大きくすることで、浄化能力を高めた脱臭装置を提供できる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社